Report



マイクロスケールの微細構造金型による 機能表面加工

松村 隆*

T. Matsumura

1. 緒言

表面の微細構造により,その表面と接触する物質との物 理的および化学的性質を制御する機能表面は,今日,多く の工業製品に応用されている¹⁾.現在,機能表面の多くは, めっき,蒸着,コーティング等の処理により表面の材質を 変化させ,一様で単一な機能を発現させている.しかし, 薄膜の剥離や摩耗により,機能性が劣化することが問題と なっている場合がある.一方,最近では,単一な表面でも 複数の機能やその強度の制御が要求されている場合も少 なくない.このような機能表面を製造するには,異物質を 表面に付与する方法では困難である.そこで,表面に微細 構造を成形し,機能を制御する技術に関心が高まっている.

表面機能の一つであるぬれ性は,材料の表面エネルギー に依存し,固体表面における液体の流れや異物質との付着 等に関連付けられている²⁾.ぬれ性は固体表面の材料のみ ならず,表面の微細構造によっても変化することが知られ ており,Wenzelはそのモデル化を試みた³⁾.また,Cassie らは撥水性に関して別のモデルを提案しており⁴⁾,Patankar は,それらのモデルを表面エネルギーの観点から議論した ⁵⁾.これらの知見に基づき,OndaらやBicoらは表面の微 細構造を加工し,撥水性の高い表面を実現した^{6),7)}.これ らの微細構造の加工は,いずれもエッチング等の化学的処 理によるものであるため,加工に対する自由度は低い.そ のため,このような微細構造を数値制御によって機械的に 加工できれば,表面機能に対する制御性が高まる⁸⁾.

以上の背景を踏まえ、本研究では表面機能としてぬれ性 と付着性を対象とし、表面の微細構造を機械的に加工して、 それらの機能を任意に制御することを目的としている.ま ず、表面の微細構造に対する機械的加工法について述べる. 次に、微細構造を有する表面におけるぬれ性の変化を調べ、 Cassie のモデルとの関連づけを試みた.また、乳酸菌の付 着に対する微細構造の影響を調べ、その理論的な背景を CFD 解析によって示した.

2. 表面微細構造の機械加工法

2.1 加工工程

集束イオンビームによるスパッタリングでは,加工速度 がきわめて遅いため,大きな表面に対して微細構造を加工



(a) FIB スパッタリング (b) インクリメンタル スタンピング



図1 微細構造の加工プロセス

することは時間的に困難である.そこで,図1の工程により広い領域に微細構造を効率的に加工する.この加工法は 以下のプロセスから構成されている.

- (1) 集束イオンビーム (Focused Ion Beam)によって、工具 先端に微細構造を加工する.以後、この工具をストラ クチャ工具と呼ぶ.
- (2) 図2のインクリメンタルスタンピング加工機によって、 数値制御(Numerical Control)でストラクチャ工具を一 定間隔で移動させながら、反転した微細構造を金属板 に押し込んで金型を加工する. 同機は、機械上部にス トラクチャ工具を固定し、被削材を固定したテーブル の上昇、下降、移動を繰り返しながら金型を製作する. 各軸はステッピングモータで駆動し、位置決め分解能 は X, Y 軸が 25µm, Z 軸が 2.5µm である. また、テ ーブル下部には圧電型動力計が取り付けられており、 工具の接触と加工時の荷重を監視する.

^{*}東京電機大学工学部機械工学科 教授



図2 インクリメンタルスタンピング加工機



(a) プラスチック成形機(試料作製用埋込み機)





(3) 製作した金型を用いたプラスチック成形により、ストラクチャ工具と同様の微細構造をプラスチックに転写する.ここでは、図3(a)に示す走査型顕微鏡などの試料作成用埋込み機を使用し、温度180℃、圧力180KPa,加熱時間20分、冷却時間20分の条件で成形した.なお、離型時のプラスチックに対する曲げによって微細構造が破損するため、図3(b)のように離型する.まず、金型外周部にプラスチックが充填されないように補助プレートをつけて成形し、成形後に金型



図5インクリメンタルスタンピングによる微細構造金型

を残してプレートを取り外す.次に,金型と同形状の 中空部を有する離型装置により,中空部内面をガイド として,ねじ機構により金型をひき抜く.

2.2 微細構造の加工事例

図4は,集束イオンビームにより140µmの領域に直径18µm,高さ18µmの微細円柱をピッチ60µmの間隔で成形したストラクチャ工具の事例である.同図(a)のように超硬合金工具の先端部を研削してスタンピング領域を限定し,集束イオンビームで,Gaイオンをドーズ量2.0×10¹⁴ions/cm²で照射する.粗工程では,プローブ電流14nAで8時間,仕上げ工程では5.2nAで8.5時間照射し,同図(b)のように9本の微細円柱の周りをスパッタリングする.

図5は、インクリメンタルスタンピングで、アルミニウム合金板の一辺2mmの領域に微細構造を加工した金型である.同図は、図4のストラクチャ工具を用いて加工したものであり、反転した微細構造になっている.また、加工時は潤滑剤として灯油を用い、摩擦による形状精度の劣化と材料の付着を抑制している.図5(b)はストラクチャ工具の突起部と金型の押込み部の形状を比較したものである. 金型のストラクチャ部は、押込み時の弾性変形により、若



干, 誤差が生じているが, 突起高さ 18μm のストラクチャ 工具の反転形状とほぼ同様のプロファイルとなり, 高精度 な押込みが確認できる.

図 6 はプラスチック成形した微細構造であり,同図(b) は使用した金型と成形したプラスチック表面の微細形状 とを比較したものである.プラスチック上の微細構造も金 型と同様であり,十分に高い精度が得られている.



(a) ストラクチャ工具



(b) 微細構造金型



(c) プラスチック成形による微細構造 図8 異種微細構造の連続成形加工

2.3 微細構造の連続制御

一般に異種微細構造を加工するためには、異なったスト ラクチャ工具を用意し、工具を交換しながら加工すること になる.しかしながら、工具製作に時間がかかるだけでな く、工具交換に伴う加工部位の位置決めが困難となる.そ こで、図7のように隣接する突起の間隔が大きいストラク チャ工具を製作し、インクリメンタルスタンピングにおけ る工具の移動ピッチを変化させて微細構造を制御する.こ の方法であれば、一つのストラクチャ工具で配列の異なる 微細構造を効率良く加工でき、工具交換や位置決めの作業 が必要ない.また、撥水性は突起の間隔に依存するため、 インクリメンタルスタンピングにおける工具の移動ピッ チを変化させることで、表面の撥水性を制御できる.

図 8 にその加工事例を示す. 同図(a)に示す一辺 6.3µm, 高さ 10µm の突起を間隔 60µm で配置したストラクチャエ 具を用い, インクリメンタルスタンピングでアルミニウム 合金板に同図(b)のように金型を製作した. ここでは, 加工 領域を 4 つに分け, それぞれをピッチ 30µm, 20µm, 15µm, 12µm で加工している. 同図(c)は製作した金型によってポ リエチレン樹脂に微細構造を転写したものである.



図10 平面における水滴形状





(a) 異方性形状異方性配列 (b) 等方性形状異方性配列



(c) 等方性形状等方性配列

図11 微細構造の形状と配列

3. 固体表面の微細構造によるぬれ性の変化

3.1 撥水性に関するモデル

Cassie-Baxter のモデルによれば、微細構造に液体を滴下 すると、図9のようにそれぞれの突起の隙間に空気が入り 込み、液体と固体の接触が限定されると撥水性が大きくな る.一般に、ぬれ性は液適法により液体と固体の接触角で 定量的に評価されており、このモデルによれば、微細構造 を有する表面の見かけ上の接触角は、以下の式で表される.

$$\cos\theta_r^C = \phi_s \cos\theta_e + \phi_s - 1 \tag{1}$$





(a) 縦横方向からの観察
 (b) 対角方向からの観察
 図 12 等方性形状異方性配列の水滴形状

 第10
 第11
 第11

(a) 平面(b) 微細構造表面図 13 金属蒸着膜表面の水滴形状

ただし ϕ_{α} は表面全体の面積に対する突起先端部分の面積 の割合である.また θ_{e} は図 10 に示すように平坦な面にお ける液体の接触角であり、ポリエチレン樹脂における水の 接触角では 96°である.

3.2 固体表面の微細構造の形状と配置

微細構造の突起形状と配置における等方性と異方性が, 水滴のぬれ性に及ぼす影響を調べた.図11はポリエチレ ン樹脂に微細構造を作成した例である.同図(a)は,一辺 6µm,高さ10µm,突起間隔20µmの正方形突起を格子状 に配列した微細構造である.これは突起および配置の対角 方向と縦横方向の大きさと距離が異なり,両者に対して異 方性のある構造となっている.同図(b)は,直径6µm,高 さ10µm,突起間隔20µmの円形突起を格子状に配列した 微細構造であり,形状に対しては等方的であるが,配置に 対して異方性を有している.同図(c)は,直径6µm,高さ 10µm,突起間隔20µmの円形突起を六方向に配置した構造 であり,形状および配置に対して等方性がある.

3.3 微細構造がぬれ性に及ぼす影響

図 12 はポリエチレン樹脂で,配列異方性のある微細構 造の表面における水滴形状である.同図は,正方配列の縦 横方向と対角方向から観察した場合を比較したものであ り,突起間の距離の違いによって接触角が異なる

図 13(a)は平坦なポリエチレン樹脂に金を 1000 Å蒸着させた表面の水滴形状である.表面は撥水性から親水性に変化し,接触角は 80°となっている.同図(b)は金薄膜を有する図 11(c)の微細構造に対して,水滴形状を示したものである.図 13(a)と比較すると,さらに接触角が減少し微細構造によって接触角が変化していることが確認できる.



図 14 微細構造表面の øs と接触角の関係

図 14 は接触角と&の関係を示したものである.ポリエ チレン樹脂に対する水のぬれ性は撥水性を示し,その傾向 は Cassie-Baxter のモデルと同様に, &の減少に伴い接触角 が増加する.さらに突起の形状および配置が等方的な場合 は、モデルに最も近い特性を示している.また,接触角に 対する突起形状の影響は大きくないが,配列における異方 性は, &に対する接触角の変化率に影響する.一方,ポリ エチレン樹脂に金薄膜を蒸着すると,同図(b)のように& の減少に伴い接触角が減少し,微細構造によって,より親 水性が大きくなる.

4. 固体表面の微細構造による付着性制御

4.1 付着試験

乳酸菌 LG21 を 0.2%に希釈した溶液を, 平面および間隔 30µm のピラーで構成される微細構造表面に流して付着性 を比較した.図 15 は試験後に表面を乾燥させ,レーザ顕 微鏡で乳酸菌の付着状況を観察したものである.同図の黒 点が乳酸菌であり平面上には多くの付着が観察されるが, 微細構造表面には,乳酸菌の付着は少ない.特にピラー間 に乳酸菌の付着がないため,図9のようにピラー底部への 液体の侵入がないと考えられる.

図 16 は両者の表面における乳酸菌の液滴形状を示した ものである. 微細構造を有する表面の水滴の接触角は大き く, 付着性の抑制は微細構造の撥水性に起因することが確 認できる.





図 17 平坦部と微細構造部の CFD における解析モデル



図18 平坦部と微細構造部の流速分布

4.2 CFDに基づく付着性抑制に対する考察

微細構造が付着性を抑制する効果を流体力学的に検討 するために,図 17 に示す解析モデルに基づき定常流れを 解析した.ただし,液体の物性値は,20℃の水のものを用 いている.ポリエチレン樹脂の固体表面が撥水性であるこ とから, Cassie-Baxter のモデルに基づき,図9のように突 起間は、気体と考え摩擦係数を0としている.また、流れは同図の左から右に流れ、入口部での流速を0.1m/sとした.

図 18 は平坦部と微細構造部における液体の流速分布を 示したものである.平坦部における固体と液体との接触界 面では流速は 0m/s となるため,表面近傍では乳酸菌が付 着しやすい.一方,微細構造部では,固体と液体との接触 は,突起上部のみであるため流速降下が小さい.そのため, 乳酸菌が付着する確率は小さくなる.以上のように,微細 構造が液体の流れの場に及ぼす影響からも付着性が抑制 されることがわかる.

5. 結論

- (1) 表面にマイクロオーダの微細構造を高能率に加工するために、微細金型を用いたプラスチック成形法を提案した。金型は、集束イオンビームのスパッタリングによって微細構造を有するストラクチャ工具の製作し、そのストラクチャ工具を用いたインクリメンタルスタンピングにより製作する。その金型を用いたプラスチック成形によって、微細構造を有する表面を高能率に精度良く加工できる。
- (2) 間隔の広いストラクチャ工具を製作し,移動ピッチを 制御することで,一つのストラクチャ工具で複数の微 細構造を連続的に精度良く加工できる.
- (3) 微細構造を有する表面によって、液体のぬれ性が変化 する.ポリエチレン樹脂のような撥水性を有するぬれ 性は、微細構造部の固体表面と液体との接触面積の割 合が小さくなるほど、撥水性が大きくなる.一方、金 属表面のように親水性の高い表面では、微細構造によ って親水性が高くなる.
- (4) 乳酸菌の微細構造を有する表面の付着性は、ぬれ性と 関連付けられ、撥水性を有する材料では、表面への付 着量が少ない.また、平坦部における液体の流れは、 固体表面の近くで流速が低下し、乳酸菌が付着しやす

い.一方,微細構造を有する表面では,流速降下が小 さく,付着しにくい.

謝 辞

本研究は公益財団法人天田財団(元 天田金属加工機械 技術振興財団)平成21年度一般研究開発助成にて実施した ものである.ここに,記して謝意を表する.

参考文献

- Bruzzone A.A.G., Costa H.L., Lonardo P.M., Lucca D.A.: Advances in engineered surfaces for functional performance. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 57 (2008) ,750–769.
- Hartland S.: Surface and Interfacial Tension- Measurement, Theory, and Application, (2004), Marcel Dekker, Inc., New York, NY.
- Wenzel R.L.: Resistance of Solid Surfaces to Wetting by Water, Industrial and Engineering Chemistry, 28-8 (1936), 988-994.
- Cassie A.B.D., Baxter S.: Wettability of porous surfaces. Trans. Faraday Soc., 40 (1944), 546-551.
- Patanker N.A.: On the Modeling of Hydrophobic Contact Angles on Rough Surfaces, Langmuir, 19 (2003), 1249-1253.
- Onda T., Shibuichi S., Satoh N., Tsujii K.: Super-Water-Repellent Fractal Surfaces, Langmuir, 12 (1996), 2125-2127.
- Bico J., Marzolin C., Quere D.: Pearl Drops, Europhysics Letter, 47-2 (1999), 220-226.
- Yoshino M., Matsumura T., Umehara N., Akagami Y., Aravindan S., Ohno T.: Engineering surface and development of a new DNA micro array chip. Wear, 260 (2006), 274-286.